

Rastermikroskop

- 5 Die Erfindung betrifft ein Rastermikroskop mit mindestens einer Lichtquelle, die ein Beleuchtungslichtstrahlenbündel erzeugt, mit einem akustooptischen Bauteil zur Einstellung der Lichtleistung des Beleuchtungslichtstrahlenbündels und mit einer Strahlablenkeinrichtung zum Führen des Beleuchtungslichtstrahlenbündels über bzw. durch eine Probe.
- 10 In der Scanmikroskopie wird eine Probe mit einem Lichtstrahl beleuchtet, um das von der Probe emittierte Reflexions- oder Fluoreszenzlicht zu beobachten. Der Fokus eines Beleuchtungslichtstrahles wird mit Hilfe einer steuerbaren Strahlablenkeinrichtung, im Allgemeinen durch Verkippen zweier Spiegel, in einer Objektebene bewegt, wobei die Ablenkachsen meist senkrecht aufeinander stehen, so dass ein Spiegel in x-, der andere in y-Richtung ablenkt. Die Verkippung der Spiegel wird beispielsweise mit Hilfe von Galvanometer-Stellelementen bewerkstelligt. Die Leistung des vom Objekt kommenden Lichtes wird in Abhängigkeit von der Position des Abtaststrahles gemessen. Üblicherweise werden die Stellelemente mit Sensoren zur 15 Ermittlung der aktuellen Spiegelstellung ausgerüstet.
- 20 Speziell in der konfokalen Scanmikroskopie wird ein Objekt mit dem Fokus eines Lichtstrahles in drei Dimensionen abgetastet. Ein konfokales Scanmikroskop umfasst im Allgemeinen eine Lichtquelle, eine Fokussieroptik, mit der das Licht der Quelle auf eine Lochblende – die sog. Anregungsblende 25 - fokussiert wird, einen Strahlteiler, eine Strahlablenkeinrichtung zur

Strahlsteuerung, eine Mikroskopoptik, eine Detektionsblende und die Detektoren zum Nachweis des Detektions- bzw. Fluoreszenzlichtes. Das Beleuchtungslicht wird beispielsweise über einen Strahlteiler eingekoppelt. Das vom Objekt kommende Fluoreszenz- oder Reflexionslicht gelangt über

5 die Strahlablenkeinrichtung zurück zum Strahlteiler, passiert diesen, um anschließend auf die Detektionsblende fokussiert zu werden, hinter der sich die Detektoren befinden. Detektionslicht, das nicht direkt aus der Fokusregion stammt, nimmt einen anderen Lichtweg und passiert die Detektionsblende nicht, so dass man eine Punktinformation erhält, die durch sequentielles

10 Abtasten des Objekts zu einem dreidimensionalen Bild führt.

Anstelle des Strahlteilers kann zum Einkoppeln des Anregungslichts mindestens einer Lichtquelle in das Mikroskop und zum Ausblenden des am Objekt gestreuten und reflektierten Anregungslichts bzw. der Anregungswellenlänge aus dem über den Detektionsstrahlengang vom Objekt

15 kommenden Lichts auch eine als akustooptisches Bauteil ausgestaltete optische Anordnung vorgesehen sein, wie beispielsweise aus der Deutschen Offenlegungsschrift DE 199 06 757 A1 bekannt ist.

Meist wird ein dreidimensionales Bild durch schichtweise Bilddatennahme erzielt, wobei die Bahn des Abtastlichtstrahles auf bzw. in dem Objekt idealer

20 Weise einen Mäander beschreibt. (Abtasten einer Zeile in x-Richtung bei konstanter y-Position, anschließend x-Abtastung anhalten und per y-Verstellung auf die nächste abzutastende Zeile schwenken und dann, bei konstanter y-Position, diese Zeile in negative x-Richtung abtasten u.s.w.). Um eine schichtweise Bilddatennahme zu ermöglichen, wird der Probentisch oder

25 das Objektiv nach dem Abtasten einer Schicht verschoben und so die nächste abzutastende Schicht in die Fokusebene des Objektivs gebracht.

Bei einigen mikroskopischen Anwendungen ist es notwendig, die Probe während des Abrasters oder zwischen zwei Abrastervorgängen manipulieren zu können. Eine Manipulation kann beispielsweise das Freisetzen gebundener

30 Farbstoffe, einen Bleichvorgang, einen Schneidvorgang oder die Anwendung einer optischen Pinzette beinhalten.

Aus US 6,094,300 ist ein Laser-Scanning-Mikroskop mit einer ersten Lichtquelle, deren Licht von einem ersten Scanner über eine Probe geführt wird, und mit einer zweiten Lichtquelle, deren Licht als Manipulationslicht von einem zweiten Scanner über die Probe führbar ist, bekannt.

5 Auch DE 100 39 520 A1 offenbart ein Rastermikroskop mit zwei Strahlablenkeinrichtungen, die jeweils das Licht unterschiedlicher Lichtquellen, unabhängig voneinander über bzw. durch eine Probe führen.

10 Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Rastermikroskop anzugeben, mit dem eine Probe sowohl beobachtbar als auch manipulierbar ist, wobei die Zahl der mindestens erforderlichen Lichtquellen reduziert ist und darüber hinaus eine schnelle Modulation der Manipulations- bzw. Beleuchtungslichtleistung ermöglicht ist.

15 Diese Aufgabe wird durch ein Rastermikroskop gelöst, das dadurch gekennzeichnet ist, dass das akustooptische Bauteil ein Teillichtstrahlenbündel aus dem Beleuchtungslichtstrahlenbündel räumlich abspaltet, und dass Strahlführungsmittel vorgesehen sind, die das Teillichtstrahlenbündel – vorzugsweise zur Manipulation – auf die Probe lenken.

20 Das erfindungsgemäße Rastermikroskop hat den Vorteil, dass mit dem Beleuchtungslichtstrahlenbündel und mit dem Teillichtstrahlenbündel unabhängig voneinander die Probe simultan oder sequenziell beobachtet und manipuliert werden kann. Hierbei ist es ermöglicht, die Lichtleistung im Beleuchtungslichtstrahlenbündel und im Teillichtstrahlenbündel präzise und schnell einzustellen.

25 Vorteilhafterweise kann als Teillichtstrahlenbündel das Licht verwendet werden, das ein die Lichtleistung regelndes akustooptisches Bauteil ohnehin in eine Strahlfalle lenken würde.

30 In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung beinhaltet das akustooptische Bauteil einen AOTF (acousto optical tunable filter).

Vorzugsweise ist eine weitere Strahlablenkeinrichtung zum Führen des Teillichtstrahlenbündels über bzw. durch die Probe vorgesehen. Die weitere Strahlablenkeinrichtung kann, wie in der Rastermikroskopie üblich,

Galvanometerspiegel oder akustooptisch ablenkende Scanner oder

5 beispielsweise Mikrospiegel beinhalten.

Das Rastermikroskop beinhaltet ein Objektiv, das das Beleuchtungslichtstrahlenbündel auf die Probe fokussiert. Vorzugsweise fokussiert das Objektiv auch das Teillichtstrahlenbündel auf die Probe. Hierzu werden die Strahlengänge des Beleuchtungslichtstrahlenbündels bzw. des

10 Teillichtstrahlenbündels nach Passieren der Strahlablenkeinrichtung bzw. der weiteren Strahlablenkeinrichtung vor dem Objektiv zusammengeführt.

In einer anderen vorteilhaften Ausgestaltungsform des Rastermikroskops ist ein weiteres Objektiv vorgesehen, das das Teillichtstrahlenbündel auf die Probe fokussiert. Bei dieser Variante kann die Probe beispielsweise von oben

15 durch das Objektiv beobachtet werden, während gleichzeitig von unten durch ein weiteres Objektiv bzw. durch den Kondensor eine Probenmanipulation erfolgen kann.

Vorzugsweise beinhalten die Strahlführungsmittel, die das Teillichtstrahlenbündel auf die Probe lenken, einen Lichtleiter.

20 In einer besonderen Variante spaltet das akustooptische Bauteil den Anteil aus dem Beleuchtungslichtstrahlenbündel als Teillichtstrahlenbündel ab, der eine bestimmte Polarisationseigenschaft aufweist. Beispielsweise kann das von der Lichtquelle ausgehende Beleuchtungslichtstrahlenbündel linear polarisiert sein, wobei das akustooptische Bauteil beispielsweise den saggital

25 polarisierten Anteil als Teillichtstrahlenbündel abspaltet und den tangential polarisierten Anteil als Beleuchtungslichtstrahlenbündel passieren lässt. Durch Drehung der Polarisationsebene des von der Lichtquelle ausgehenden Beleuchtungslichtstrahlenbündels mit einem Polarisationsbeeinflussungsmittel, das beispielsweise als $\lambda/2$ -Platte ausgebildet sein kann,

30 lässt sich das Verhältnis der Lichtleistungen von Teillichtstrahlenbündel und

von dem durch das akustooptische Bauteil getretenen Beleuchtungslichtstrahlenbündels einstellen.

Vorzugsweise sind Kompensationsmittel vorgesehen, die eine von dem akustooptischen Bauteil hervorgerufene räumliche spektrale Aufspaltung des

5 Teillichtstrahlenbündels und/oder des Beleuchtungslichtstrahlenbündels kompensieren. Diese Kompensationsmittel können beispielsweise als Prisma und/oder als Gitter und/oder als weiteres akustooptisches Bauteil ausgebildet sein. Die Kompensation einer räumlich spektralen Aufspaltung ist insbesondere dann wichtig, wenn das Teillichtstrahlenbündel und/oder das
10 Beleuchtungslichtstrahlenbündel zum weiteren Transport in eine Lichtleitfaser eingekoppelt werden sollen.

In einer ganz besonders bevorzugten Ausgestaltungsvariante lenkt das akustooptische Bauteil von der Probe ausgehendes Detektionslicht mittelbar oder unmittelbar zu einem Detektor bzw. einer Detektoranordnung. In diesem

15 Fall fungiert das akustooptische Bauteil zusätzlich als akustooptischer Beamsplitter, wie er beispielsweise in DE 199 06 757 A1 offenbart ist.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsvariante ist das Rastermikroskop ein konfokales Rastermikroskop.

20 In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand schematisch dargestellt und wird anhand der Figuren nachfolgend beschrieben, wobei gleiche oder gleich wirkende Elemente mit denselben Bezugszeichen versehen sind. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäßes Rastermikroskop,

Fig. 2 ein weiteres erfindungsgemäßes Rastermikroskop,

25 Fig. 3 ein anderes erfindungsgemäßes Rastermikroskop.

Fig. 4 eine Detailansicht des Strahlverlaufs im Bereich eines akustooptischen Bauteils und

Fig. 5 eine weitere Detailansicht des Strahlverlaufs im Bereich eines akustooptischen Bauteils.

30 Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Rastermikroskop mit einer ersten

Lichtquelle 1, die als Argon-Krypton-Laser ausgebildet ist und einer zweiten Lichtquelle 3, die als Helium-Neon-Laser ausgebildet ist. Das von der Lichtquelle 1 erzeugte erste Laserlicht 5 wird mit Hilfe eines dichroitischen Strahlteilers 7 mit dem von der zweiten Lichtquelle 3 emittierten zweiten Laserlicht 9 zu einem Beleuchtungslichtstrahlenbündel 11 vereinigt. Im Strahlengang des Beleuchtungslichtstrahlenbündels 11 befindet sich ein als AOTF 13 ausgebildetes akustooptisches Bauteil 15 zur Einstellung der Lichtleistung des Beleuchtungslichtstrahlenbündels. Das akustooptische Bauteil spaltet aus dem Beleuchtungslichtstrahlenbündel 11 ein Teillichtstrahlenbündel 16 ab, das über den Umlenkspiegel 17 zu einer weiteren Strahlablenkeinrichtung 19, die einen weiteren kardanisch aufgehängten Scanspiegel 21 beinhaltet, geführt wird. Von der weiteren Strahlablenkeinrichtung 19 gelangt das Teillichtstrahlenbündel 16 über einen weiteren Umlenkspiegel 23 zu einem dichroitischen Strahlumlenker 26, der das Teillichtstrahlenbündel 16 durch das Objektiv 25 zur Manipulation auf die Probe 27 lenkt. Der übrige Teil des Beleuchtungslichtstrahlenbündels wird mit einem Hauptstrahlteiler 29 zu einer Strahlablenkeinrichtung 31, die einen kardanisch aufgehängten Scanspiegel 33 beinhaltet, geführt. Die Strahlablenkeinrichtung 31 führt das Beleuchtungslichtstrahlenbündel 11 durch die nicht gezeigte Scanoptik und die ebenfalls nicht gezeigte Tubusoptik und das Objektiv 25 über die Probe 27. Das von der Probe ausgehende Detektionslicht 35 gelangt auf demselben Lichtweg, nämlich durch das Objektiv 25 durch die nicht gezeigte Scanoptik und die nicht gezeigte Tubusoptik hindurch zur Strahlablenkeinrichtung 31 zurück und trifft nach Passieren des Hauptstrahlteilers 29 und des Detektionspinholes 37 auf die Detektionseinrichtung 39, die zur Leistung des Detektionslichts proportionale elektrische Signale erzeugt. Die erzeugten elektrischen Detektionssignale werden an eine Verarbeitungseinheit 41 weitergegeben, die auf dem Monitor 43 eines PCs 46 ein Abbild der Probe darstellt. Die Strahlablenkeinrichtung 31 und die weitere Strahlablenkeinrichtung 19 werden gemäß den Vorgaben des Benutzers von der Verarbeitungseinheit 41 gesteuert. Im Strahlengang des ersten Lasers ist eine $\lambda/2$ -Platte 45 vorgesehen, mit der die Polarisationslichtrichtung des vom ersten Laser emittierten Lichts 5 einstellbar

ist. Ebenso ist im Strahlengang des zweiten Lasers 3 eine zweite $\lambda/2$ -Platte 47 als Polarisationsbeeinflussungsmittel 49 vorgesehen, die zur Einstellung der Polarisationsrichtung des vom zweiten Laser emittierten Lichts 9 dient. Durch Drehen der $\lambda/2$ -Platten 45, 47 lässt sich das Verhältnis der Lichtleistungen des 5 Teillichtstrahlenbündels 16 zu dem des Beleuchtungslichtstrahlenbündels 11 bezüglich der jeweiligen von den Lasern emittierten Lichtwellenlängen Anteile einstellen.

Fig. 2 zeigt ein weiteres erfindungsgemäßes Rastermikroskop, bei dem das akustooptische Bauteil 15 als AOTF 13 ausgebildet ist. Der AOTF 13 hat bei 10 diesem Rastermikroskop zusätzlich die Aufgabe, das von der Probe ausgehende Detektionslicht 35, der Detektoreinrichtung 39 zuzuführen. Gleichzeitig spaltet der AOTF 13 ein Teillichtstrahlenbündel 16 ab, das nach Durchlaufen eines als weiteren AOTF 51 ausgeführten Kompensationsmittel 15 mit Hilfe der Optik 55 in eine Lichtleitfaser 57 eingekoppelt wird. Das mit 15 Hilfe der weiteren Optik 59 aus der Lichtleitfaser 57 ausgekoppelte Teillichtstrahlenbündel 16 gelangt anschließend zu der weiteren Strahlablenkeinrichtung 19 und wird analog wie bei dem in Fig. 1 gezeigten Rastermikroskop über bzw. durch die Probe geführt.

Fig. 3 zeigt eine weitere Variante eines erfindungsgemäßen 20 Rastermikroskops, bei dem ein weiteres Objektiv 61 vorgesehen ist, um das von der weiteren Strahlablenkeinrichtung 19 gesteuerte Teillichtstrahlenbündel 16 von unten auf die Probe 27 zu lenken.

Fig. 4 zeigt eine Detallansicht der Wirkungsweise des akustooptischen Bauteils 15, das als AOTF 13 ausgeführt ist. Das von der ersten und der 25 zweiten Lichtquelle kommende Licht 5, 9 wird mit einem Strahlvereiniger 7 zu einem Beleuchtungslichtstrahlenbündel 11 vereinigt und von der durch den AOTF 13 laufenden akustischen Welle gebeugt und aufgespalten. Der AOTF 13 spaltet aus dem Beleuchtungslichtstrahlenbündel 11 ein 30 Teillichtstrahlenbündel 16 ab, das über Strahlführungsmittel als Manipulationslicht auf die Probe 27 gelenkt wird. Es handelt sich hierbei um die erste Beugungsordnung für saggital polarisiertes Licht. In der ersten Ordnung für tangential polarisiertes Licht befindet sich der Teil des

Beleuchtungslichtstrahlenbündels 11, der zur Strahlablenkeinrichtung 31 geführt wird. Das übrige Licht, nämlich das, das akut nicht benötigt wird, befindet sich hauptsächlich in der nullten Beugungsordnung und wird in eine Strahlfalle 63 gelenkt. Prinzipiell wäre es jedoch auch möglich, dieses Licht

5 zur Manipulation auf die Probe zu lenken. Mit Hilfe einer $\lambda/2$ -Platte 45 im Strahlengang des Lichtes 5 lässt sich die Orientierung der Linearpolarisation des Lichts 5 und damit das Verhältnis der Lichtleistungen des Teillichtstrahlenbündels 16 und des in die erste Ordnung gebeugten Beleuchtungslichtstrahlenbündels 11 einstellen.

10 Fig. 5 zeigt eine weitere Detailansicht, bei der der AOTF 13 ein Teillichtstrahlenbündel 16 abspaltet, das von einem Umlenkspiegel 65 zu einem Kompensationsmittel 53 gelenkt wird. Das Kompensationsmittel besteht aus einem weiteren AOTF 51, der so angeordnet ist, dass er die räumlich spektrale Aufspaltung, die durch den AOTF 13 verursacht wurde, rückgängig

15 macht, so dass die verschiedenen spektralen Anteile des Teillichtstrahlenbündels 16 weitgehend koaxial verlaufen. Bei diesem Ausführungsbeispiel befindet sich das Teillichtstrahlenbündel 16 in der nullten Beugungsordnung, während das der Strahlablenkeinrichtung zuzuführende Beleuchtungslichtstrahlenbündel 11 in der ersten Beugungsordnung zu finden

20 ist.

Die Erfindung wurde in Bezug auf eine besondere Ausführungsform beschrieben. Es ist jedoch selbstverständlich, dass Änderungen und Abwandlungen durchgeführt werden können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehenden Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste:

1	Lichtquelle	
3	Lichtquelle	
5	5	erstes Laserlicht
7	Strahlteilers	
9	zweites Laserlicht	
11	Beleuchtungslichtstrahlenbündel	
13	AOTF	
10	15	akustooptisches Bauteil
16	Teillichtstrahlenbündel	
17	Umlenkspiegel	
19	weitere Strahlablenkeinrichtung	
21	weiterer Scanspiegel	
15	23	weiterer Umlenkspiegel
25	Objektiv	
26	Strahlumlenker	
27	Probe	
29	Hauptstrahlteiler	
20	31	Strahlablenkeinrichtung
33	Scanspiegel	
35	Detektionslicht	
37	Detektionspinhole	
39	Detektionseinrichtung	
25	41	Verarbeitungseinheit

	43	Monitor
	45	$\lambda/2$ -Platte
	46	PC
	47	$\lambda/2$ -Platte
5	49	Polarisationsbeeinflussungsmittel
	51	weiterer AOTF
	53	Kompensationsmittel
	55	Optik
	57	Lichtleitfaser
10	59	weitere Optik
	61	weiteres Objektiv
	63	Strahlfalle
	65	Umlenkspiegel

Patentansprüche

1. Rastermikroskop mit mindestens einer Lichtquelle, die ein Beleuchtungslichtstrahlenbündel erzeugt, mit einem akustooptischen Bauteil zur Einstellung der Lichtleistung des Beleuchtungslichtstrahlenbündels und mit einer Strahlablenkeinrichtung zum Führen des Beleuchtungslichtstrahlenbündels über bzw. durch eine Probe, dadurch gekennzeichnet, dass das akustooptische Bauteil ein Teillichtstrahlenbündel aus dem Beleuchtungslichtstrahlenbündel räumlich abspaltet, und dass Strahlführungsmittel vorgesehen sind, die das Teillichtstrahlenbündel – vorzugsweise zur Manipulation – auf die Probe lenken.
2. Rastermikroskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das akustooptische Bauteil einen AOTF (acousto optical tunable filter) beinhaltet.
3. Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine weitere Strahlablenkeinrichtung zum Führen des Teillichtstrahlenbündels über bzw. durch eine Probe vorgesehen ist.
4. Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein Objektiv vorgesehen ist, das das Beleuchtungslichtstrahlenbündel auf die Probe fokussiert.
5. Rastermikroskop nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Objektiv das Teillichtstrahlenbündel auf die Probe fokussiert.
6. Rastermikroskop nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein weiteres Objektiv vorgesehen ist, das das Teillichtstrahlenbündel auf die Probe fokussiert.
7. Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Strahlführungsmittel einen Lichtleiter beinhalten.
8. Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das akustooptische Bauteil den Anteil aus dem

Beleuchtungslichtstrahlenbündel als Teillichtstrahlenbündel abspaltet, der eine bestimmte Polarisationseigenschaft aufweist.

9. Rastermikroskop nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der mindestens einen Lichtquelle und dem akustooptischen Bauteil ein Polarisationsbeeinflussungsmittel angeordnet ist.
5
10. Rastermikroskop nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass Polarisationsbeeinflussungsmittel eine $\lambda/2$ -Platte beinhaltet.
10
11. Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass Kompensationsmittel vorgesehen sind, die eine von dem akustooptischen Bauteil hervorgerufene räumliche spektrale Aufspaltung des Teillichtstrahlenbündels und/oder des Beleuchtungslichtstrahlenbündels kompensieren.
15
12. Rastermikroskop nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Kompensationsmittel ein Prisma und/oder ein Gitter und/oder ein weiteres akustooptisches Bauteil beinhalten.
15
13. Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das akustooptische Bauteil von der Probe ausgehendes Detektionslicht zu einem Detektor lenkt.
15
14. Rastermikroskop nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass das Rastermikroskop ein konfokales Rastermikroskop ist.
20

Fig. 1

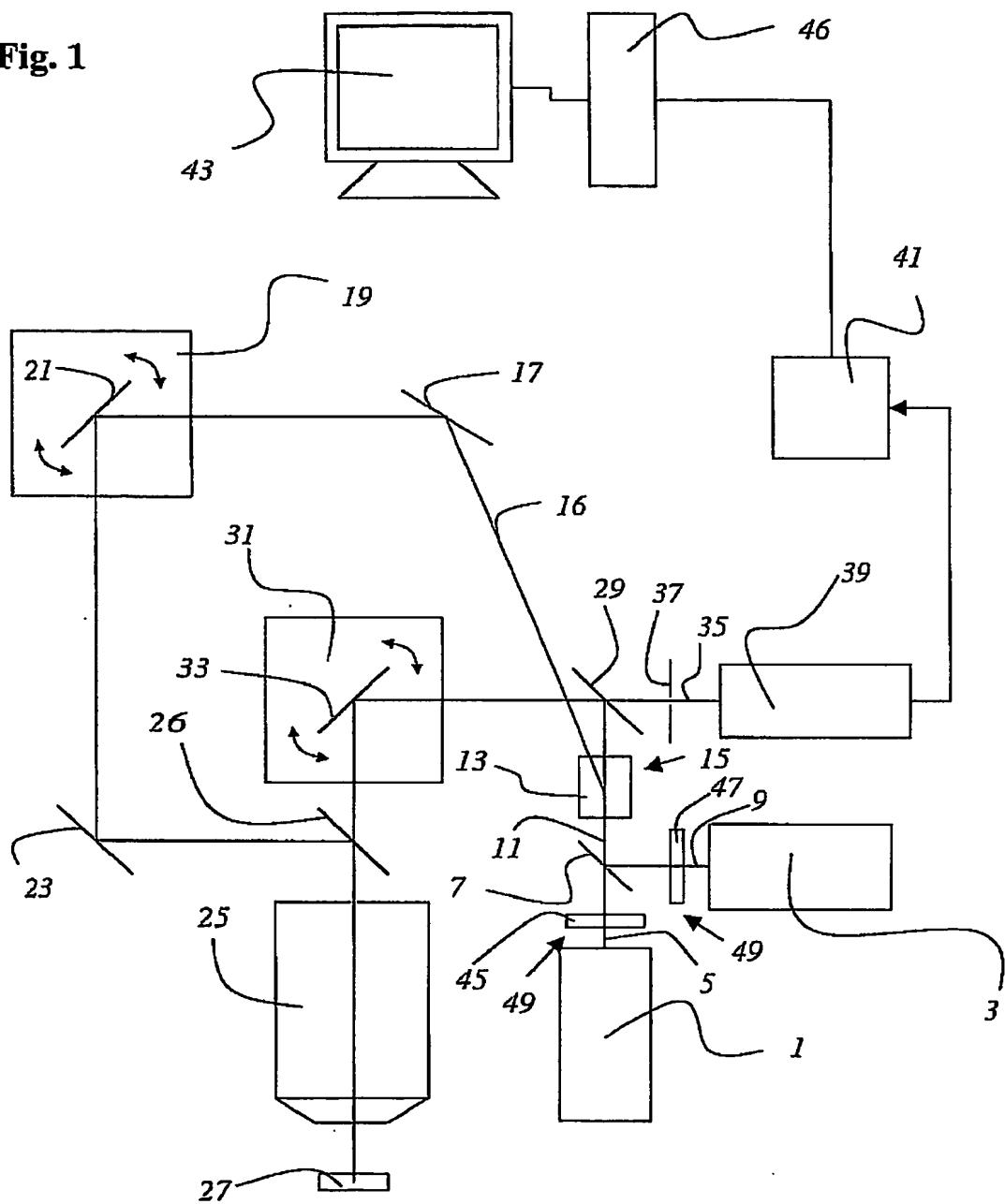
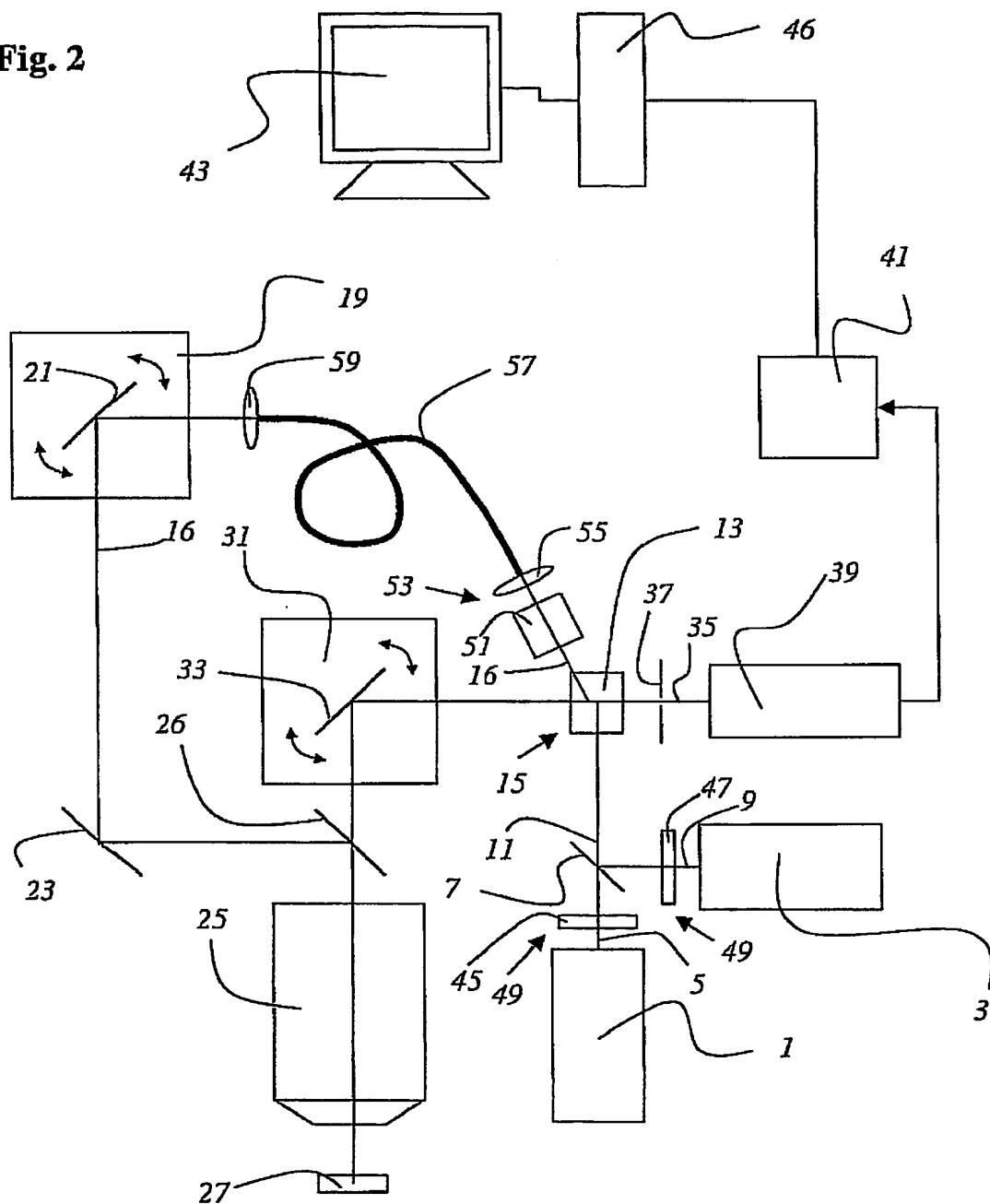
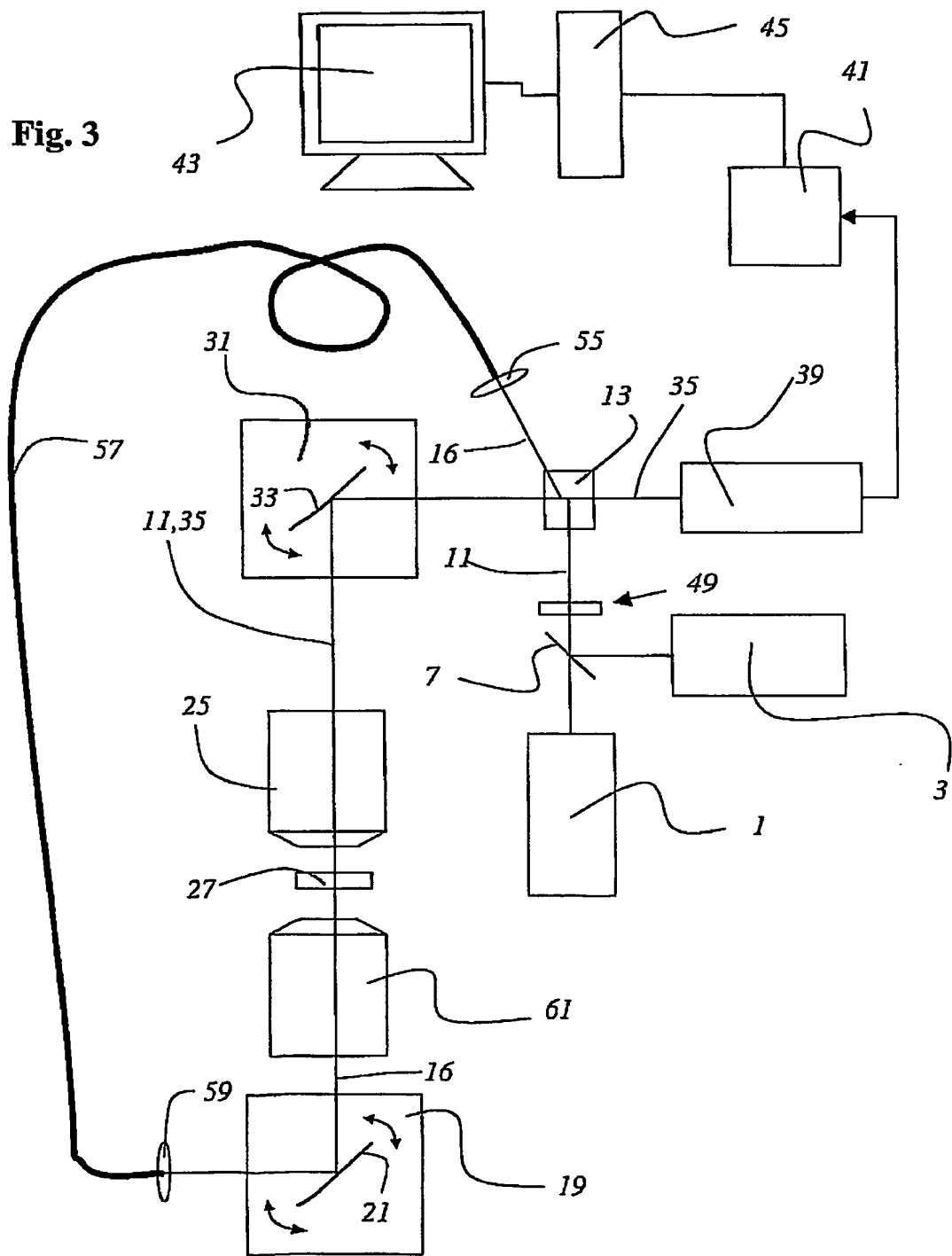


Fig. 2



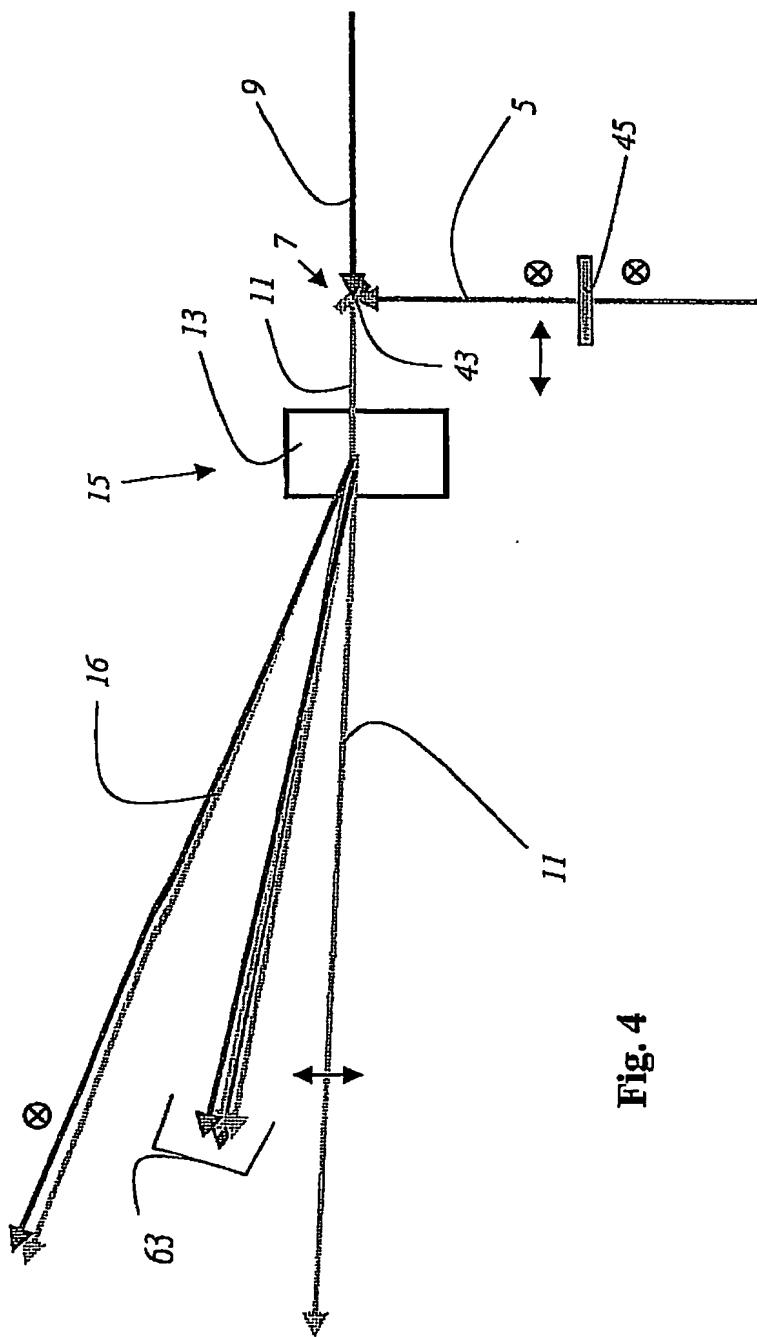


Fig. 4

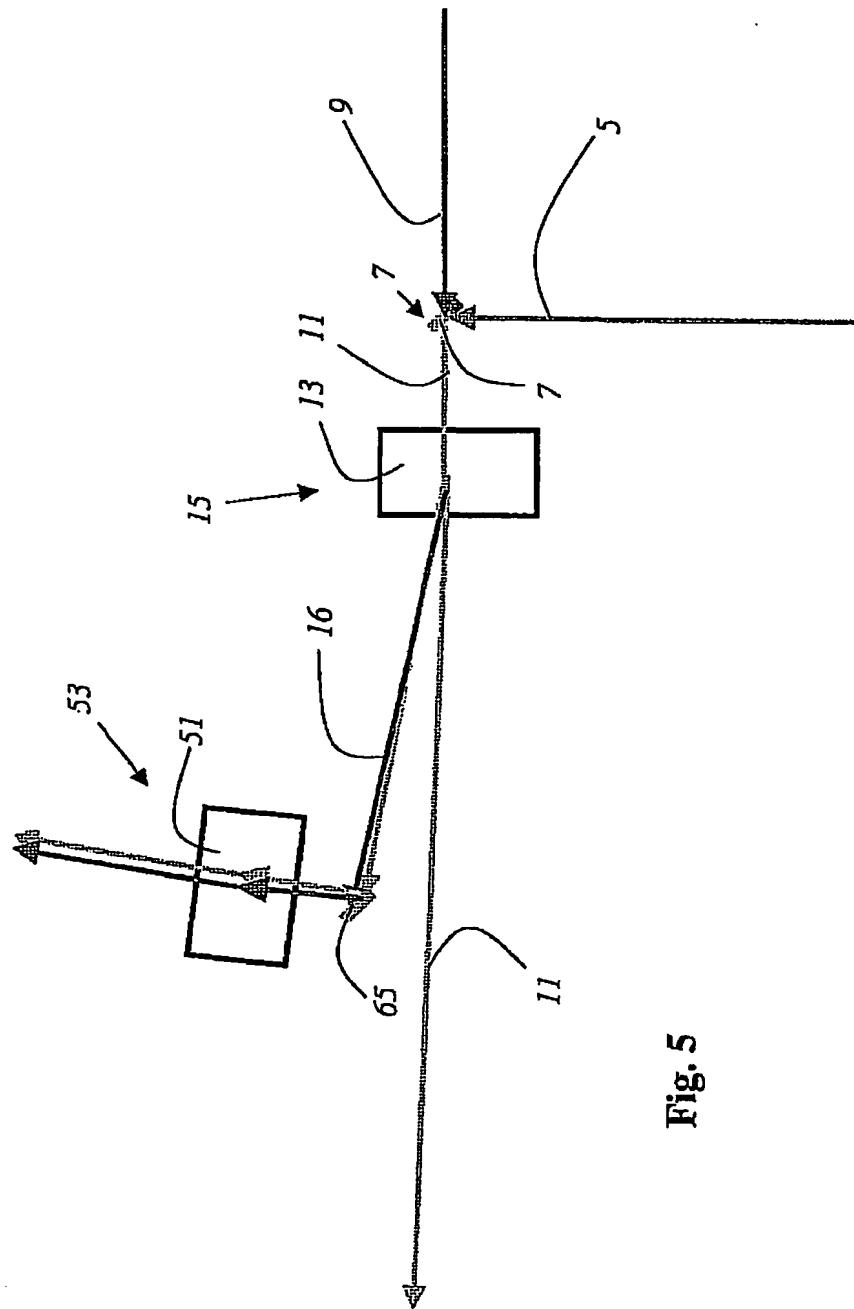


Fig. 5

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G02B21/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 G02B

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 100 39 520 A (LEICA MICROSYSTEMS) 21 February 2002 (2002-02-21) cited in the application figures claim 21 paragraph '0024! paragraph '0047! – paragraph '0057! -----	1-14
A	US 6 094 300 A (KASHIMA SHINGO ET AL) 25 July 2000 (2000-07-25) cited in the application figures 1,2,22 column 7, line 4 – column 11, line 20 column 22, line 46 – column 23, line 29 ----- -/-	1-14

Further documents are listed in the continuation of box C.

Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 January 2005

Date of mailing of the International search report

21/01/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL – 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Windecker, R

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 2002/027709 A1 (ENGELHARDT JOHANN ET AL) 7 March 2002 (2002-03-07) figure 1 paragraph '0032! - paragraph '0036! paragraph '0045! - paragraph '0048! -----	1,2,4,5, 13,14
X	EP 1 178 345 A (LEICA MICROSYSTEMS) 6 February 2002 (2002-02-06) figure paragraph '0020! - paragraph '0028! -----	1,2,4,5, 13,14
A	EP 1 085 362 A (LEICA MICROSYSTEMS) 21 March 2001 (2001-03-21) paragraph '0024! - paragraph '0025!; figure 1 -----	8-14

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/052519

Patent document cited in search report	Publication date		Patent family member(s)		Publication date
DE 10039520	A	21-02-2002	DE 10039520 A1 DE 5010 3520 D1 EP 1186930 A2 JP 2002082287 A US 2002020800 A1		21-02-2002 14-10-2004 13-03-2002 22-03-2002 21-02-2002
US 6094300	A	25-07-2000	JP 10206742 A		07-08-1998
US 2002027709	A1	07-03-2002	DE 1004 3992 A1		21-03-2002
EP 1178345	A	06-02-2002	DE 10038049 A1 EP 1178345 A1 JP 2002122787 A US 2002021440 A1		14-02-2002 06-02-2002 26-04-2002 21-02-2002
EP 1085362	A	21-03-2001	DE 1994 4355 A1 EP 1085362 A2 JP 2001124997 A US 6525812 B1		22-03-2001 21-03-2001 11-05-2001 25-02-2003

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G02B21/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBiete

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G02B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie ^o	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 100 39 520 A (LEICA MICROSYSTEMS) 21. Februar 2002 (2002-02-21) in der Anmeldung erwähnt Abbildungen Anspruch 21 Absatz '0024! Absatz '0047! – Absatz '0057! -----	1-14
A	US 6 094 300 A (KASHIMA SHINGO ET AL) 25. Juli 2000 (2000-07-25) in der Anmeldung erwähnt Abbildungen 1,2,22 Spalte 7, Zeile 4 – Spalte 11, Zeile 20 Spalte 22, Zeile 46 – Spalte 23, Zeile 29 ----- -/-	1-14

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :
- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem Internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendeadatum des Internationalen Recherchenberichts
11. Januar 2005	21/01/2005
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Windecker, R

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 2002/027709 A1 (ENGELHARDT JOHANN ET AL) 7. März 2002 (2002-03-07) Abbildung 1 Absatz '0032! - Absatz '0036! Absatz '0045! - Absatz '0048! ----- EP 1 178 345 A (LEICA MICROSYSTEMS) 6. Februar 2002 (2002-02-06) Abbildung Absatz '0020! - Absatz '0028! ----- EP 1 085 362 A (LEICA MICROSYSTEMS) 21. März 2001 (2001-03-21) Absatz '0024! - Absatz '0025!; Abbildung 1 -----	1,2,4,5, 13,14 1,2,4,5, 13,14 8-14
A		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffent

-n, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/052519

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 10039520	A 21-02-2002	DE	10039520 A1	21-02-2002
		DE	50103520 D1	14-10-2004
		EP	1186930 A2	13-03-2002
		JP	2002082287 A	22-03-2002
		US	2002020800 A1	21-02-2002
US 6094300	A 25-07-2000	JP	10206742 A	07-08-1998
US 2002027709	A1 07-03-2002	DE	10043992 A1	21-03-2002
EP 1178345	A 06-02-2002	DE	10038049 A1	14-02-2002
		EP	1178345 A1	06-02-2002
		JP	2002122787 A	26-04-2002
		US	2002021440 A1	21-02-2002
EP 1085362	A 21-03-2001	DE	19944355 A1	22-03-2001
		EP	1085362 A2	21-03-2001
		JP	2001124997 A	11-05-2001
		US	6525812 B1	25-02-2003